

カスタムPtfе実験室用洗浄バスケットキャリア

高純度耐酸耐アルカリウェーハホルダー 低バックグラウンド 汚染フリー

化学浴ラック

商品番号: PL-CP268



前書き

半導体および微量分析向けに設計された高純度カスタムPTFE洗浄バスケットキャリアをご覧ください。これらの耐酸ラックは、溶出ゼロと超低バックグラウンドレベルを保証し、精密な実験室洗浄プロセスにおいて最も過酷な化学環境下でも信頼性の高い性能を提供します。

[詳細を学ぶ](#)

用途	説明	主な利点
半導体ウェーハ洗浄	クリーンルーム環境でのRCA洗浄またはHFエッチング工程中のシリコンウェーハの安全な保持。	金属汚染を防止し、均一な化学的暴露を保証。
微量金属分析	ICP-OESおよびICP-MSサンプル調製に使用される実験器具の洗浄および溶出、pptレベル純度達成のため。	容器材料自体からのバックグラウンド干渉を排除。
電池研究	電解液浸漬または化学処理段階中の陽極および陰極材料の取り扱い。	過酷な有機溶剤およびリチウム塩への耐性。
医薬品滅菌	高温または化学的に過酷な滅菌サイクルを通じたガラスバイアルまたは精密部品の搬送。	純度を維持し、有効成分の表面吸着を防止。
航空宇宙部品脱脂	過酷な化学脱脂剤による深部洗浄サイクル中の精密加工合金部品の保持。	工業用強度洗浄試薬での長期的耐久性。
太陽電池製造	湿式化学処理およびテクスチャリング段階中の光起電性基板の支持。	エッチング剤に対する耐熱性と化学的適合性。
地質サンプル調製	元素分析のための濃縮フッ化水素酸を使用した鉱物サンプルの分解および洗浄。	容器の劣化なしに危険な酸環境での安全な取り扱い。
仕様カテゴリ	PL-CP268のパラメータ詳細	値 / 能力
材料特性	主要構造材料	バージン高純度PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)
	微量元素バックグラウンド	超低 (PPTレベル分析に適す)
	耐薬品性	普遍的 (溶融アルカリ金属/フッ素を除く)
	吸水率	<0.01%
物理的寸法	構成	クライアント仕様に完全にカスタマイズ可能
	サイズオプション	2インチ、4インチ、6インチ、8インチ、12インチウェーハまたはカスタム実験器具向け特注設計
	取り扱い機能	オプションの一体型ハンドル、伸縮アーム、またはロック式蓋

用途	説明	主な利点
仕様カテゴリ	PL-CP268のパラメータ詳細	値 / 能力
熱的限界	最高使用温度	260°C (500°F)
	最低使用温度	-200°C (-328°F)
製造詳細	製造方法	高精度CNC加工
	表面粗さ	Ra 0.4 - 0.8 μm (標準) / 研磨オプションあり
	品番参照	PL-CP268